

AES オージェ電子分光分析装置



PHI 700 Xi
走査型オージェ電子分光分析装置

オージェ分析径8nm以下、
究極の表面微小部分分析

オージェ分析用コンポーネント
* その他コンポーネント各種

Auger Electron Spectroscopy

CMA: 同軸円筒鏡型電子分光器



XPS X線光電子分光分析装置



PHI 5000 VersaProbe
多機能走査型X線光電子分光分析装置

ビーム径10 μ m以下の
走査型X線による、自動中和・
モノクロXPS測定を実現。

X-ray Photoelectron Spectroscopy



PHI Quantera SXM
走査型X線光電子分光分析装置
* その他特型XPS装置製作

SIMS 二次イオン質量分析装置



PHI TRIFT V nanoTOF
飛行時間型二次イオン質量分析装置

LMIGクラスターイオン銃による
サブミクロンの有機物分析を
実現。
3次元分析へ

Secondary Ion Mass Spectrometry



PHI ADEPT-1010
四重極型二次イオン質量分析装置

Ion Gun



20kV C60イオン銃

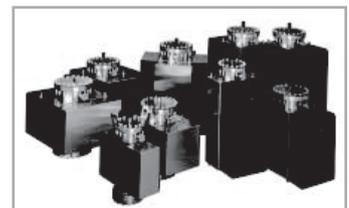


ガスクラスターイオン銃

(各種Ionoptika社製品)

Ion Pump

各種サイズの
イオンポンプ
を提供。



(各種Gamma Vacuum社製品)

アルバック・ファイ株式会社

本社・工場 〒253-8522 茅ヶ崎市円蔵370番地 TEL: 0467-85-4220 (国内営業部) FAX: 0467-85-4411
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-31 上村ニッセイビル5階 TEL: 06-6350-2670 FAX: 06-6350-2980

www.ulvac-phi.com